

Especificaciones del Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) Zeiss EVO MA10

Fabricante: Carl Zeiss Microscopy GmbH (Jena, Alemania)

Año de compra: 2010

Modelo: EVO MA10

Resolución:

- 3 nm a 30 kV
- 4.5 nm a 30 kV con presión variable
- 10 nm a 3 kV

Rango de presiones: 10–400 Pa

Máxima altura de la muestra: 100 mm

Detectores:

- Secundarios estándar (SE)
- Retrodispersados (AsB)
- Secundarios con presión variable (VPSE)
- Detector EDS Oxford LINCA X-Max